

특허권 침해(Ⅱ)

Q 특허권의 통상실시권자도 특허권이 침해된 경우 권리 침해 주장을 할 수 있습니까?

A 특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지를 청구할 수 있습니다(특허법 제126조). 또한 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 손해배상을 청구할 수 있습니다(특허법 제128조). 따라서 통상실시권자는 직접 법적구제조치를 청구 할 수 없으며, 특허권자 또는 전용실시권자가 청구인이 되어야 합니다.

Q 특허권 침해로 인한 손해배상청구의 요건은 무엇입니까?

A 특허권침해에 대한 손해배상청구의 요건은 일반적인 손해배상청구 소송에 있어서와 동일합니다. 먼저, 침해자의 위법행위가 존재해야 하며, 침해자가 자신의 행위가 특허권의 침해가 됨을 알거나(고의), 또는 상당한 주의를 기울리하여 알지 못하고(과실), 침해행위로 인하여 손해가 발생해야 합니다. 특허법에서는 특허발명은 특허공보 등을 통하여 일반에게 공시되는 점을 이유로 침해자의 과실을 추정하고(특허법 제130조), 손해액의 계산에 있어서도 판매 수량에 의하여 손해액을 추정하도록 하고 있습니다(특허법 제128조).

Q 특허권 침해자에 대하여 형사적으로 처벌하기 위해서는 반드시 고소절차를 취해야 합니까?

A 특허권 또는 전용실시권이 고의에 의해 침해되었을 때는 특허권자는 그 침해자에 대하여 형사적으로 침해 책임을 추궁할 수 있습니다. 특허권침해죄는 특허권자의 고소가 있어야 하는 친고죄이며(특허법 제225조), 고소기간은 범인을 안 날로부터 6개월 이내이어야 합니다(형사소송법 제230조). 특허권침해자에 대하여는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처하며(특허법 제225조), 법인의 대표자, 법인 또는 개인의 대리인·사용자 기타 종업원이 그 범

인 또는 개인의 업무에 관하여 침해죄를 범한 경우에는 해당 법인 또는 개인에도 일정한 벌금형을 부과합니다(특허법 제230조). 또한 침해행위를 조정한 물건 또는 그 침해행위로부터 생긴 물건은 몰수하거나 피해자의 청구에 의하여 피해자에게 교부할 것을 선고하게 됩니다(특허법 제231조).

Q 특허권 침해여부를 특허심판을 통해서 확인 받을 수 있는 방법은 없습니까?

A 특허권의 침해여부에 대한 판단은 구체적인 소송의 형태로서 민·형사소송을 통해서 이루어집니다. 다만, 특허심판의 하나로서 ‘권리범위확인심판’을 통해서 타인의 실시행위가 자신의 권리범위에 포함되는지의 여부를 확인 받을 수 있습니다(특허법 제135조). 권리범위확인심판은 단순히 특허권의 범위를 확정하는 심판이 아니고 특허발명을 중심으로 어떤 대상물이 적극적으로 그 특허권의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 그에 속하지 아니함을 확인하는 심판을 말합니다.

권리범위 확인심판의 종류에는 1)적극적인 권리범위확인심판: 특허권자가 비권리자인 “(가)호 발명”의 실시자를 상대로 하여 청구하며, 따라서 심판청구의 취지는 ““(가)호 발명”은 특허발명의 권리범위에 속한다”라는 심결을 구하는 것과 2)소극적 권리범위확인심판: 비권리자인 “(가)호 발명”의 실시자가 특허권자를 상대로 청구하는 것입니다. 따라서 심판청구의 취지는 ““(가)호 발명”은 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다”라는 심결을 구하는 것이 있습니다.



김석현 변리사

현국제특허법률사무소를 설립한 바 있고, 이국제특허법률사무소에서 대표 변리사를 지냈다. 현재 변호사, 회계사, 변리사 등 100여 명의 전문가들이 one-stop서비스를 제공하는 법무법인 총정에서 특허부 총괄을 맡고 있다.
문의 : (02)772-2786
e-mail : kimsh@hmpj.com

■자료제공 : 법무법인 총정

플라스틱 렌즈를 이용한 고해상도 광학계

공개특허공보

국 제 분 류 : G02B 13/18(2006.01), G02B 9/12(2006.01)

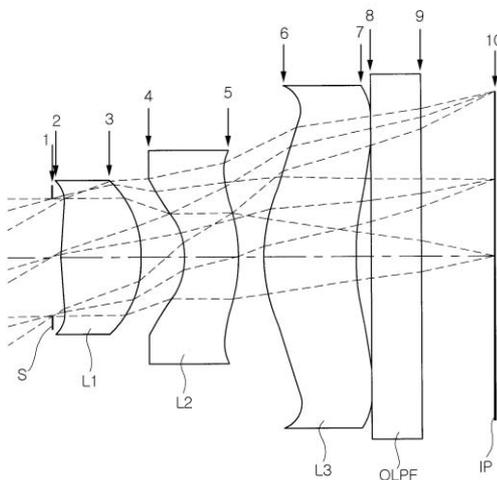
공개번호 : 10-2006-0062130

출원번호 : 10-2004-0100877

출원인 : 삼성전기 주식회사

요약

플라스틱 재질의 렌즈만을 이용한 고해상도 광학계가 제공된다. 상기 플라스틱 렌즈를 이용한 고해상도 광학계는, 물체측 가장 가까이 개구조리개를 배치하고 이후 물체측으로부터 순서대로, 양의 굴절력을 갖는 플라스틱 재질의 제1 렌즈; 음의 굴절력을 갖는 플라스틱 재질의 제2 렌즈; 및 양의 굴절력을 갖는 플라스틱 재질의 제3 렌즈; 를 포함하며, 상기 제2 렌즈의 굴절률과 아베수(ABBE NUMBER)에 관하여 $1.59 < N2 < 1.65$, $20 < N2 < 30$ 의 조건식을 만족한다(단, $N2$: 제2 렌즈의 굴절률, $N2$: 제2 렌즈의 아베수). 이와 같은 고해상도 광학계에 의하면, 플라스틱 렌즈만을 이용하여 소형 경량이면서 고해상도의 광학계를 구현할 수 있다.



광학렌즈 조정장치 및 그 조정방법

공개특허공보

국 제 분 류 : G02B 7/02(2006.01), G02B 7/08(2006.01)

공개번호 : 10-2006-0050242

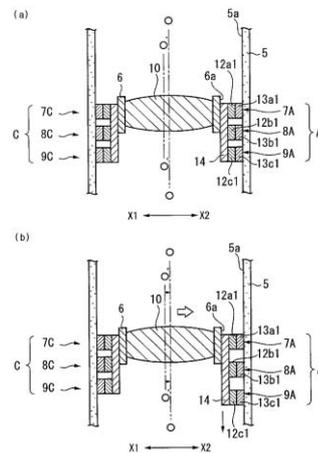
출원번호 : 10-2005-0071645

출원인 : 알프스 덴키 가부시기가이샤

요약

본 발명은 출하 후에 있어서의 광축의 조정을 자동적으로 행하는 것이 가능한 광학렌즈의 조정장치 및 그 조정방법을 제공하는 것이다.

이를 위하여 본 발명에서는 렌즈(10)를 유지하는 홀더(6)와 경통(5)과의 사이에 설치되어 있는 구동수단(A)의 구동부(7A, 8A, 9A)를 구성하는 바깥쪽 전극(13A1, 13B1, 13C1)과 공통 전극(14)과의 사이에 전압을 인가하면, 도 9B에 나타내는 바와 같이 상기 구동부(7A, 8A, 9A)에 설치된 각 유전 일래스토머(ELASTOMER)(12A1, 12B1, 12C1)가 X1 - X2 방향으로 눌러 찌그러지는 방향으로 약간 변형되기 때문에, 렌즈(10) 전체를 화살표방향(X2 방향)으로 약간 이동시킬 수 있다. 이에 의하여 상기 렌즈(10)의 광축(O' - O)을 기준 광축(O - O)에 일치 또는 근접시키는 것이 가능해진다.



광 픽업 장치용 렌즈 유닛, 광학 소자, 렌즈 유닛용 미러프레임, 렌즈 유닛의 조립 방법 및 광 픽업 장치

공개특허공보

국 제 분 류 : G11B 7/135(2006.01), G11B 7/08(2006.01)

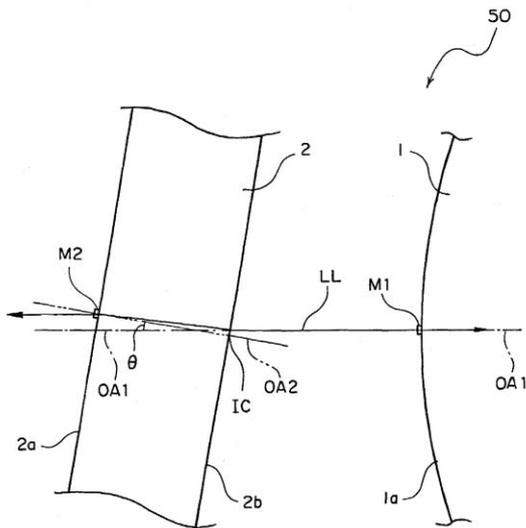
공개번호 : 10-2006-0050719

출원번호 : 10-2005-0078969

출원인 : 코니카 미놀타 옵토 인코포레이티드

요약

광 픽업 장치용 렌즈 유닛은, 광원으로부터의 출사광을 광 정보 기록매체의 정보 기록면 상에 집광시키는 대물 렌즈와, 상기 대물 렌즈에 대하여 광원측에 배치되어, 광원으로부터의 출사광의 위상을 제어하는 위상 구조를 갖는 광학면을 갖는 위상 제어 소자와, 상기 대물 렌즈와 상기 위상 제어 소자를 유지하는 지지 부재를 갖고, 상기 위상 제어 소자는, 그 광축이 상기 대물 렌즈의 광축에 대하여 소정 각도 경사지고, 또한 상기 위상 제어 소자의 광축이 상기 위상 구조를 갖는 광학면과 교차하는 교점이, 상기 대물 렌즈의 광축을 통과하는 중심 연장 광로 상에 배치된 상태에서 유지되어 있다.



대물 렌즈 및 광학 소자의 설계 방법

공개특허공보

국제분류 : G11B 7/135(2006.01)

공개번호 : 10-2006-0061274

출원번호 : 10-2005-0116388

출원인 : 펜탁스 가부시카가이사

요약

광학계에 사용될 광학 소자를 설계하는 설계 방법으로서, 광학계에서는 다른 설계 파장을 갖는 복수의 광 빔의 각각이 광학 소자를 통과하고, 상기 설계 방법은 복수의 광 빔의 회절 효율이 최대화되는 회절 차수간 제1 광로차 함수에 의해 초래되는 비율이 복수의 광 빔의 회절 효율이 최대화되는 회절 차수간 제2 광로차 함수에 의해 초래되는 비율과 다르게 되는 방식으로 제1 및 제2 광로차 함수를 포함하는, 적어도 2개 유형의 광로차 함수를 결정하는 결정 단계 및 적어도 2개 유형의 광로차 함수를 중첩하여 규정되는 형상을 획득하여 그 획득된 형상을 광학 소자의 면 중 적어도 하나의 면에 적용하는 획득 단계를 포함한다.

